

研究評価委員会「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」（事後評価）分科会

日時：2021年12月17日（金）10：20～16：00

場所：NEDO 川崎 2301～2303 会議室（オンラインあり）

議事次第

（公開セッション）

1. 開会、資料の確認	10:20～10:25	(5分)
2. 分科会の設置について	10:25～10:40	(15分)
3. 分科会の公開について		(—)
4. 評価の実施方法について		(—)
5. プロジェクトの概要説明		
5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント	10:40～11:00	(20分)
5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し	11:00～11:20	(20分)
5.3 質疑応答	11:20～11:45	(25分)
昼食、入替	11:45～12:45	(60分)

（非公開セッション）

6. プロジェクトの詳細説明		
6.1 次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発		
[説明 20分、質疑応答 10分]	12:45～13:15	(30分)
入替	13:15～13:20	(5分)
6.2 高品位レーザー加工技術の開発		
[説明 15分、質疑応答 10分]	13:20～13:45	(25分)
休憩、入替	13:45～13:55	(10分)
6.3 高効率加工用 GaN 系高出力・高ビーム品質半導体レーザーの開発		
[説明 10分、質疑応答 10分]	13:55～14:15	(20分)
入替	14:15～14:20	(5分)
6.4 高輝度青色半導体レーザー及び加工技術の開発		
[説明 10分、質疑応答 10分]	14:20～14:40	(20分)
入替	14:40～14:45	(5分)
6.5 次々世代加工に向けた新規光源・要素技術開発		
[説明 10分、質疑応答 10分]	14:45～15:05	(20分)
入替	15:05～15:10	(5分)
7. 全体を通しての質疑	15:10～15:25	(15分)
休憩、入替	15:25～15:35	(10分)

（公開セッション）

8. まとめ・講評	15:35～15:55	(20分)
9. 今後の予定	15:55～16:00	(5分)
10. 閉会		